

WORKSHOP 2016

SIM II – Surfaces et Interfaces dans les Matériaux

23-24 juin 2016
Hôtel Best Western, Fuveau (F)



Bruker vous invite à venir à observer vos échantillons par profilométrie confocale interférométrique optique.

En effet, la technique permet d'observer une topographie de surface sur des champs d'analyse compris entre quelques dizaines de μm^2 à plusieurs mm^2 . L'outil permet d'obtenir une résolution latérale de plusieurs centaines de nanomètres. Le débattement en Z, allant jusqu'à 1 cm, permet d'analyser des échantillons à la fois pentus et rugueux. L'analyse sub-nanométrique, sur des échantillons ultra plans, reste toutefois possible grâce à l'interféromètre.

Que vos échantillons soient opaques, réfléchissants, plans ou rugueux, venez sur le stand Bruker Nano Surface apprécier l'analyse topographique et métrologique de vos échantillons